

信州大学 先端研究施設利用促進事業 使用料一覧

(1) 成果占有利用の場合の使用料・・・基本使用料+維持費+操作料 (委託分析の場合のみ)

※コンサルティング料(分析方法の指導) 5000円/h

※データ解析作業料 3000円/h

	装置名称	基本使用料	維持費	操作料	備考
長野	高分解能透過型電子顕微鏡(TEM)	2000円/h	2000円/h	1500円/h	試料作製時間もカウント
	ラマン散乱スペクトル測定装置	2000円/h	500円/h		
	燃焼式元素分析装置	1500円/h	1500円/h		前処理もカウント
	高速比表面積測定装置	3000円/sample	3000円/sample		
	CFRPオートクレーブ	5000円/run	3000円/run		
	万能材料試験機	1000円/2h	1000円/2h		
	落錘式衝撃試験装置	1000円/2h	2000円/2h		
	電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)	1500円/h	1500円/h		
	電子線マイクロアナライザー(EPMA)	2000円/h	2000円/h		
	レーザーフラッシュ法熱定数測定装置	1000円/h	500円/h		
	X線光電子分光装置(XPS)	1500円/h	1000円/h		粗引き時間(3時間)は カウント外 ※1
	高温摩擦摩耗試験機	1000円/h	1000円/sample		常温
	振動試料型磁力計(VSM)	2000円/h	1000円/h		暖気運転(30分)はカウント外
	高感度薄膜磁歪測定装置	2000円/h	1000円/h		暖気運転(30分)はカウント外
	広倍率動的磁区構造観察装置	2000円/h	1000円/h		暖気運転(30分)はカウント外
	集束イオンビーム加工機(FIB)	1500円/h	2000円/h		
	超高温雰囲気焼成装置	1500円/h	1000円/h		
	微小領域2次元X線回折装置(IP-XRD)	1000円/h	1000円/h		
	ホットエンボス装置	2000円/h	1000円/h		
	万能材料試験機(5kN)	1000円/2h	1000円/2h		
上田	高性能X線光電子分析装置	1500円/h	1500円/h	使用は5時間より	
	走査型電子顕微鏡(EPMA付随)	1500円/h	1000円/h		
	高周波誘電結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)	1500円/h	1000円/h		
	ゼータ電位測定装置	1000円/h	500円/h	測定用セルは各社負担	
	複合材料力学特性評価装置	1500円/2h	1000円/2h		
	繊維およびFRPのエロージョン評価装置	1000円/h	500円/h		
松本	高圧透過型分析電子顕微鏡	1200円/h	1300円/h	試料作製料金は別途	
	透過型分析電子顕微鏡	1200円/h	800円/h	試料作製料金は別途	
	電界放射型分析走査電子顕微鏡	1200円/h	800円/h	試料作製料金は別途	
	nanoLC質量分析装置	1000/Injection	500/Injection	測定のみ	
	MALDI-TOF 質量分析装置	1500円/h	1000円/h	測定のみ	

※1 X線光電子分光装置(XPS)デブスプロファイル追加料金:1μ mのスパッタに対して10,000円を追加

(2) 成果非占有利用の場合の使用料・・・基本使用料+操作料(*積算利用時間24時間までは無料)

※コンサルティング料(分析方法の指導) 5000円/h

※データ解析作業料 3000円/h

	装置名称	基本使用料	維持費	操作料	備考
長野	高分解能透過型電子顕微鏡(TEM)	2000円/h	無料	1500円/h*	試料作製時間もカウント
	ラマン散乱スペクトル測定装置	2000円/h			
	燃焼式元素分析装置	1500円/h			前処理もカウント
	高速比表面積測定装置	3000円/sample			
	CFRPオートクレーブ	5000円/run			
	万能材料試験機	1000円/2h			
	落錘式衝撃試験装置	1000円/2h			
	電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)	1500円/h			
	電子線マイクロアナライザー(EPMA)	2000円/h			
	レーザーフラッシュ法熱定数測定装置	1000円/h			
	X線光電子分光装置(XPS)	1500円/h			粗引き時間(3時間)は カウント外 ※1
	高温摩擦摩耗試験機	1000円/h			常温
	振動試料型磁力計(VSM)	2000円/h			暖気運転(30分)はカウント外
	高感度薄膜磁歪測定装置	2000円/h			暖気運転(30分)はカウント外
	広倍率動的磁区構造観察装置	2000円/h			暖気運転(30分)はカウント外
	集束イオンビーム加工機(FIB)	1500円/h			
	超高温雰囲気焼成装置	1500円/h			
	微小領域2次元X線回折装置(IP-XRD)	1000円/h			
	ホットエンボス装置	2000円/h			
	万能材料試験機(5kN)	1000円/2h			
上田	高性能X線光電子分析装置	1500円/h		使用は5時間より	
	走査型電子顕微鏡(EPMA付随)	1500円/h			
	高周波誘電結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)	1500円/h			
	ゼータ電位測定装置	1000円/h		測定用セルは各社負担	
	複合材料力学特性評価装置	1500円/2h			
	繊維およびFRPのエロージョン評価装置	1000円/h			
松本	高圧透過型分析電子顕微鏡	1200円/h		試料作製料金は別途	
	透過型分析電子顕微鏡	1200円/h		試料作製料金は別途	
	電界放射型分析走査電子顕微鏡	1200円/h		試料作製料金は別途	
	nanoLC質量分析装置	1000/Injection		測定のみ	
	MALDI-TOF 質量分析装置	1500円/h		測定のみ	

※1 X線光電子分光装置(XPS) デプスプロファイル追加料金:1μ mのスパッタに対して10,000円を追加